

论文

## 利用扫描力显微镜测量表面静电势

张兆祥, 赵兴钰, 侯士敏, 薛增泉

北京大学电子学系, 北京, 100871

收稿日期 1999-7-20 修回日期 1999-8-4 网络版发布日期 2008-10-13 接受日期

摘要

该文叙述了利用扫描力显微镜测量表面静电势的工作原理, 并给出了不同类型扫描静电势显微镜的框图, 以及利用它得到的一些实验结果。

关键词 [表面静电势](#) [扫描力显微镜](#) [扫描静电势显微镜](#)

分类号 [TM933](#)

## MEASUREMENT OF SURFACE ELECTROSTATIC POTENTIAL USING SCANNING FORCE MICROSCOPY

Zhang Zhaoxiang, Zhao Xingyu, Hou Shimin, Xue Zengquan

Department of Electronics Peking University Beijing 100871 China

Abstract

The operating principle of using scanning force microscopy(SFM) to measure surface electrostatic potential is described in this article, and the block diagrams of different mode and a few experimental results are given simultaneously.

Key words [Surface electrostatic potential](#) [Scanning force microscopy](#) [Scanning electrostatic potential microscopy](#)

DOI:

通讯作者

作者个人主页 张兆祥; 赵兴钰; 侯士敏; 薛增泉

### 扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(1073KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [复制索引](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中包含“表面静电势”的相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

- [张兆祥](#)
- [赵兴钰](#)
- [侯士敏](#)
- [薛增泉](#)